ガスクロマトグラフ質量分析装置利用登録願

年　　月　　日

材料創造研究センター
ガスクロマトグラフ質量分析装置 担当者殿

下記の者にガスクロマトグラフ質量分析装置［ 新規 ・ 継続 ］利用の登録をお願い致します。

利用期間:　　年　　月　　日 ～　　年 3 月 31 日 (最大1年間まで)

【新規登録者の場合，必ず記入】　　**＊本装置の講習は装置担当者に相談のこと。**

講習日:　　年　　月　　日　　講習者:　　㊞

下記の者による当該装置の利用に関して責任を負います。

研究室　　指導教員:　　㊞

「安全の手引」を読み，確認したらチェック ⇩

学 年	学生番号	氏　　名	メ　ー　ル　ア　ド　レ　ス	✓

以下，センター使用欄

装置の利用を許可します。

年　　月　　日

材料創造研究センター 装置担当者

㊞

X線小角散乱/広角回折装置利用登録願

年　　月　　日

材料創造研究センター
X線小角散乱/広角回折装置 担当者殿

下記の者にX線 ［ 1. 小角散乱 / 2. 広角回折 ］ 装置 ［ 新規 ・ 継続 ］ 利用の登録をお願い致します。

利用期間:　　年　　月　　日 ～　　年 3 月 31 日 (最大1年間まで)

【新規登録者の場合，必ず記入】　　＊本装置の講習は装置担当者に相談のこと。

講習日:　　年　　月　　日　　講習者:　　㊞

下記の者による当該装置の利用に関して責任を負います。

研究室　　指導教員:　　㊞

「安全の手引」を読み，確認したらチェック ⇩

学 年	学生番号	氏　　名	メ　ー　ル　ア　ド　レ　ス	✓

以下，センター使用欄

装置の利用を許可します。

年　　月　　日

材料創造研究センター 装置担当者

㊞

電子スピン共鳴装置利用登録願

年　　月　　日

材料創造研究センター
電子スピン共鳴装置 担当者殿

下記の者に電子スピン共鳴装置［ 新規 ・ 継続 ］利用の登録をお願い致します。

利用期間:　　年　　月　　日 ～　　年 3 月 31 日 (最大1年間まで)

【新規登録者の場合，必ず記入】　　**＊本装置の講習は装置担当者に相談のこと。**

講習日:　　年　　月　　日　　講習者:　　㊞

下記の者による当該装置の利用に関して責任を負います。

研究室　　指導教員:　　㊞

「安全の手引」を読み，確認したらチェック ⇩

学 年	学生番号	氏　　名	メ　ー　ル　ア　ド　レ　ス	✓

以下，センター使用欄

装置の利用を許可します。

年　　月　　日

材料創造研究センター 装置担当者

㊞

MALDI–TOF/TOF型質量分析装置利用登録願

年　　月　　日

材料創造研究センター
MALDI–TOF/TOF型質量分析装置 担当者殿

下記の者にMALDI–TOF/TOF型質量分析装置［ 新規 ・ 継続 ］利用の登録をお願い致します。

利用期間:　　年　　月　　日 ～　　年 3 月 31 日 (最大1年間まで)

【新規登録者の場合，必ず記入】　　＊本装置の講習は装置担当者に相談のこと。

講習日:　　年　　月　　日　　講習者:　　㊞

下記の者による当該装置の利用に関して責任を負います。

研究室　　指導教員:　　㊞

「安全の手引」を読み，確認したらチェック ⇩

学 年	学生番号	氏　　名	メ　ー　ル　ア　ド　レ　ス	✓

以下，センター使用欄

装置の利用を許可します。

年　　月　　日

材料創造研究センター 装置担当者

㊞

高速液体クロマトグラフ質量分析装置利用登録願

年　　月　　日

材料創造研究センター
高速液体クロマトグラフ質量分析装置 担当者殿

下記の者に高速液体クロマトグラフ質量分析装置［ 新規 ・ 継続 ］利用の登録をお願い致します。

利用期間:　　年　　月　　日 ～　　年 3 月 31 日 (最大1年間まで)

【新規登録者の場合，必ず記入】　　**＊本装置の講習は装置担当者に相談のこと。**

講習日:　　年　　月　　日　　講習者:　　㊞

下記の者による当該装置の利用に関して責任を負います。

研究室　　指導教員:　　㊞

「安全の手引」を読み，確認したらチェック ⇩

学 年	学生番号	氏　　名	メ　ー　ル　ア　ド　レ　ス	✓

以下，センター使用欄

装置の利用を許可します。

年　　月　　日

材料創造研究センター 装置担当者

㊞

キャピラリー電気泳動装置利用登録願

年　　月　　日

材料創造研究センター
キャピラリー電気泳動装置 担当者殿

下記の者にキャピラリー電気泳動装置［ 新規 ・ 継続 ］利用の登録をお願い致します。

利用期間:　　年　　月　　日 ～　　年 3 月 31 日 (最大1年間まで)

【新規登録者の場合，必ず記入】　　＊本装置の講習は装置担当者に相談のこと。

講習日:　　年　　月　　日　　講習者:　　㊞

下記の者による当該装置の利用に関して責任を負います。

研究室　　指導教員:　　㊞

「安全の手引」を読み，確認したらチェック ⇩

学 年	学生番号	氏　　名	メ　ー　ル　ア　ド　レ　ス	✓

以下，センター使用欄

装置の利用を許可します。

年　　月　　日

材料創造研究センター 装置担当者

㊞

LCMS-IT-TOF装置利用登録願

年　　月　　日

材料創造研究センター
LCMS-IT-TOF装置 担当者殿

下記の者にLCMS-IT-TOF装置 ［ 新規 ・ 継続 ］ 利用の登録をお願い致します。

利用期間:　　年　　月　　日 ～　　年 3 月 31 日 (最大1年間まで)

【新規登録者の場合，必ず記入】　　**＊本装置の講習は装置担当者に相談のこと。**

講習日:　　年　　月　　日　　講習者:　　㊞

下記の者による当該装置の利用に関して責任を負います。

研究室　　指導教員:　　㊞

「安全の手引」を読み，確認したらチェック ⇩

学 年	学生番号	氏　　名	メ　ー　ル　ア　ド　レ　ス	✓

以下，センター使用欄

装置の利用を許可します。

年　　月　　日

材料創造研究センター 装置担当者

㊞

400MHz FT–NMR装置利用登録願

年　　月　　日

材料創造研究センター
NMR装置 担当者殿

下記の者に400MHz FT–NMR装置［ 新規 ・ 継続 ］利用の登録をお願い致します。

利用期間:　　年　　月　　日 ～　　年 3 月 31 日 (最大1年間まで)

【新規登録者の場合，必ず記入】　　＊本装置の講習は装置担当者に相談のこと。

講習日:　　年　　月　　日　　講習者:　　㊞

下記の者による当該装置の利用に関して責任を負います。

研究室　　指導教員:　　㊞

「安全の手引」を読み，確認したらチェック ⇩

学 年	学生番号	氏　　名	メ　ー　ル　ア　ド　レ　ス	✓

以下，センター使用欄

装置の利用を許可します。

年　　月　　日

材料創造研究センター 装置担当者

㊞

示差走査熱量測定装置利用登録願

年　　月　　日

材料創造研究センター
示差走査熱量測定装置 担当者殿

下記の者に示差走査熱量測定装置［ 新規 ・ 継続 ］利用の登録をお願い致します。

利用期間:　　年　　月　　日 ～　　年 3 月 31 日 (最大1年間まで)

【新規登録者の場合，必ず記入】　　＊本装置の講習は装置担当者に相談のこと。

講習日:　　年　　月　　日　　講習者:　　㊞

下記の者による当該装置の利用に関して責任を負います。

研究室　　指導教員:　　㊞

「安全の手引」を読み，確認したらチェック ⇩

学 年	学生番号	氏　　名	メ　ー　ル　ア　ド　レ　ス	✓

以下，センター使用欄

装置の利用を許可します。

年　　月　　日

材料創造研究センター 装置担当者

㊞

熱機械分析装置利用登録願

年　　月　　日

材料創造研究センター
熱機械分析装置 担当者殿

下記の者に熱機械分析装置［ 新規 ・ 継続 ］利用の登録をお願い致します。

利用期間:　　年　　月　　日 ～　　年 3 月 31 日 (最大1年間まで)

【新規登録者の場合，必ず記入】　　＊本装置の講習は装置担当者に相談のこと。

講習日:　　年　　月　　日　　講習者:　　㊞

下記の者による当該装置の利用に関して責任を負います。

研究室　　指導教員:　　㊞

「安全の手引」を読み，確認したらチェック ⇩

学 年	学生番号	氏　　名	メ　ー　ル　ア　ド　レ　ス	✓

以下，センター使用欄

装置の利用を許可します。

年　　月　　日

材料創造研究センター 装置担当者

㊞

走査型プローブ顕微鏡装置利用登録願

年　　月　　日

材料創造研究センター
走査型プローブ顕微鏡装置 担当者殿

下記の者に走査型プローブ顕微鏡装置［ 新規 ・ 継続 ］利用の登録をお願い致します。

利用期間:　　年　　月　　日 ～　　年 3 月 31 日 (最大1年間まで)

【新規登録者の場合，必ず記入】　　**＊本装置の講習は装置担当者に相談のこと。**

講習日:　　年　　月　　日　　講習者:　　㊞

下記の者による当該装置の利用に関して責任を負います。

研究室　　指導教員:　　㊞

「安全の手引」を読み，確認したらチェック ⇩

学 年	学生番号	氏　　名	メ　ー　ル　ア　ド　レ　ス	✓

以下，センター使用欄

装置の利用を許可します。

年　　月　　日

材料創造研究センター 装置担当者

㊞

顕微ラマン測定装置利用登録願

年　　月　　日

材料創造研究センター
顕微ラマン測定装置 担当者殿

下記の者に顕微ラマン測定装置［ 新規 ・ 継続 ］利用の登録をお願い致します。

利用期間:　　年　　月　　日 ～　　年 3 月 31 日 (最大1年間まで)

【新規登録者の場合，必ず記入】　　＊本装置の講習は装置担当者に相談のこと。

講習日:　　年　　月　　日　　講習者:　　㊞

下記の者による当該装置の利用に関して責任を負います。

研究室　　指導教員:　　㊞

「安全の手引」を読み，確認したらチェック ⇩

学 年	学生番号	氏　　名	メ　ー　ル　ア　ド　レ　ス	✓

以下，センター使用欄

装置の利用を許可します。

年　　月　　日

材料創造研究センター 装置担当者

㊞

エネルギー分散型X線分析装置付
走査電子顕微鏡装置利用登録願

年　　月　　日

材料創造研究センター
エネルギー分散型X線分析装置付
走査型電子顕微鏡 (SEM/EDX) 装置 担当者殿

下記の者にSEM/EDX装置 ［ 新規 ・ 継続 ］ 利用の登録をお願い致します。

利用期間:　　年　　月　　日 ～　　年 3 月 31 日 (最大1年間まで)

【新規登録者の場合，必ず記入】　　**＊本装置の講習は装置担当者に相談のこと。**

講習日:　　年　　月　　日　　講習者:　　㊞

下記の者による当該装置の利用に関して責任を負います。

研究室　　指導教員:　　㊞

「安全の手引」を読み，確認したらチェック ⇩

学 年	学生番号	氏　　名	メ　ー　ル　ア　ド　レ　ス	✓

以下，センター使用欄

装置の利用を許可します。

年　　月　　日

材料創造研究センター 装置担当者

㊞

電界放射型走査電子顕微鏡装置利用登録願

年　　月　　日

材料創造研究センター
電界放射型走査型電子顕微鏡装置 担当者殿

下記の者に電界放射型走査型電子顕微鏡装置 ［ 新規 ・ 継続 ］ 利用の登録をお願い致します。

利用期間:　　年　　月　　日 ～　　年 3 月 31 日 (最大1年間まで)

【新規登録者の場合，必ず記入】　　**＊本装置の講習は装置担当者に相談のこと。**

講習日:　　年　　月　　日　　講習者:　　㊞

下記の者による当該装置の利用に関して責任を負います。

研究室　　指導教員:　　㊞

「安全の手引」を読み，確認したらチェック ⇩

学 年	学生番号	氏　　名	メ　ー　ル　ア　ド　レ　ス	✓

以下，センター使用欄

装置の利用を許可します。

年　　月　　日

材料創造研究センター 装置担当者

㊞

動的光散乱測定装置利用登録願

令和　　年　　月　　日

材料創造研究センター
動的光散乱測定装置 担当者殿

下記の者に動的光散乱測定装置［ 新規 ・ 継続 ］利用の登録をお願い致します。

利用期間:　　年　　月　　日 ～　　年 3 月 31 日 (最大1年間まで)

【新規登録者の場合，必ず記入】　　**＊本装置の講習は装置担当者に相談のこと。**

講習日:　　年　　月　　日　　講習者:　　㊞

下記の者による当該装置の利用に関して責任を負います。

研究室　　指導教員:　　㊞

「安全の手引」を読み，確認したらチェック ⇩

学 年	学生番号	氏　　名	メ　ー　ル　ア　ド　レ　ス	✓

以下，センター使用欄

装置の利用を許可します。

年　　月　　日

材料創造研究センター 装置担当者

㊞